

ナノテクノロジー・材料共通基盤技術検討WGの運営について（案）

1. 任務

- (1) 第 4 期科学技術基本計画の第 II 章及び第 III 章に掲げた課題の達成に向け、横断的に活用されうるナノテクノロジー・材料の技術を検討する。
- (2) 国内外の技術動向の把握・分析を行い、国際競争力の視点からナノテクノロジー・材料の技術の強化を促進する。

2. 期待される成果

- (1) 第 4 期科学技術基本計画の第 II 章及び第 III 章に掲げた課題の達成に向け、将来、必要と考えられる技術開発課題を特定し、各科学技術イノベーション戦略協議会等へ提案する。
- (2) 共通基盤技術に関する達成目標・ロードマップを作成し、科学技術イノベーション戦略協議会等と共有し、同戦略協議会等の検討へ生かす。

3. 主査の選任

- (1) 主査を互選により選出する。
- (2) 主査は、必要に応じて主査代理を指名できる。

4. 構成員の欠席

本WGに属する構成員が欠席する場合は、代理人を出席させることができる。

5. 事務局体制について

- (1) ナノテクノロジー・材料共通基盤技術検討WGの事務局は、内閣府政策統括官（共通基盤技術（ナノテクノロジー・材料）G）とする。
- (2) 必要に応じて「事務局調整ミーティング」を実施する。「事務局調整ミーティング」は、内閣府事務局と産業界等のメンバーから推薦いただいた方々を構成員として事務局としての取りまとめ等の検討を行うもの。なお、必要に応じて、各府省等のメンバーにも参加をお願いする。

6. WG の検討結果の取り扱いについて

- (1) WGの検討過程における提案又は検討結果は、各戦略協議会又は重点化課題検討TF等における議論へ反映する。
- (2) 主査は、本WGにおける検討の内容等を、議事録の公表その他適当な方法により公表する。ただし、主査が検討の内容を公表しないことが適当であるとしたと

きは、本WGの決定を経てその全部又は一部を非公表とすることができる。

7. 会議の公開性

- (1) 会議は原則公開で実施する。ただし、主査が会議を公開しないことが適切であるとしたときは、本WGの決定を経てその全部又は一部を非公開とすることができる。
- (2) 会議を公開しないこととした場合は、その理由を公表するものとする。

8. その他

- (1) 専ら半導体、MEMS 等のデバイスに関する技術は、原則としてナノテクノロジー・材料共通基盤技術検討WGでの検討対象とする。
- (2) その他本WGの運営については、主査が定めるものとする。